

## 真空プラズマ表面処理装置 V6-G 高性能卓上システム



簡便な操作のタッチスクリーンと判りやすい指示表示で簡単な操作が可能。

標準製品のV6-Gは小型卓上装置として開発され、少量量産から研究開発までの広い製造範囲をサポートします。装置は表面処理、高度クリーニング及び活性化に用いることができます。内蔵の専用制御PLCは自由に設定を行うことの出来る各プロセスと各パラメーターを保存しておくことが出来ます。

### 装置概要

- チャンバ内上側からのマイクロ波導入
- 開き戸
- 電源切断時に自動的にポンプ配管系を復圧

### 装置オプション

- 真空ポンプ
- オゾンフィルタ
- 追加ガス入力口最大2入力まで
- バラ品取り扱い用回転ドラム
- 棚付きラック
- 水平方向マイクロ波導入
- ゆっくり減圧とゆっくり復圧
- 遠隔メンテナンス (VPN経由) (VPN)/USBポート/拡張機能付きイーサネットインターフェース及びコントローラ

### 技術データ

システム外形寸法 (W x D x H): 640 x 710 x 710 mm

真空炉サイズ (W x D x H): 170 x 200 x 170 mm

プラズマ生成周波数: マイクロ波 (2.45 GHz)

マイクロ波出力: 50-300 W

流量制御器付きプロセスガス入力口: 1 チャンネル

電源: 230 V, 50/60 Hz

電源電力 (真空ポンプ入らず): 0.5 kVA

真空計: ピラニー式

本体重量: 100 kg

### ピンクジャパン株式会社

〒105-0004

東京都港区新橋 5-25-3

第2-松ビル 1F

電話 (オフィス): 03-5777-0602

ファックス: 03-5777-0604

info@pink-japan.co.jp

www.pink-japan.co.jp

### PiNK GmbH Thermosysteme

Am Kessler 6

97877 Wertheim, Germany

T +49 (0) 93 42 919-0

F +49 (0) 93 42 919-111

plasma-finish@pink.de

www.pink.de

